

「試料研磨装置」の紹介

○顕微鏡観察や元素分析を行う試料の機械研磨を行う装置です。

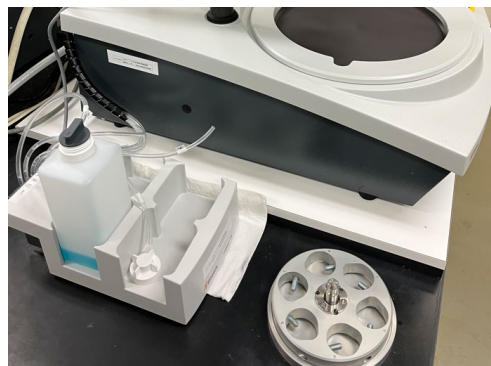
電子顕微鏡や光学顕微鏡等での観察、元素分析を行うための試料調整として、観察・分析対象となる面の機械研磨を行う装置です。電子部品、機械部品等の断面観察や元素分析、鉄筋溶接部の断面マクロ試験のための機械研磨などに使用されます。

メーカー・型式

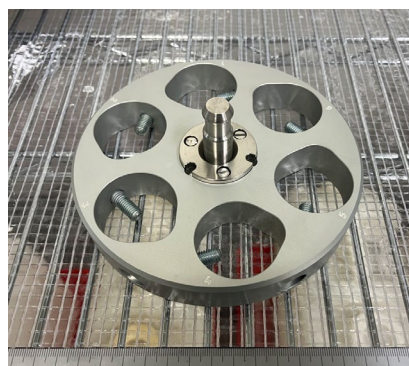
- ・メーカー : 株式会社ストラス
- ・型式 : LaboPol-30

<主な仕様>

- ・標準試料ホルダー寸法 : $\phi 25 \sim 40 \text{mm} \times 6 \text{個}$
- ・研磨盤直径 : 300mm
- ・研磨盤回転速度 : 50～500rpm
- ・試料保持部回転速度 : 50～150rpm
- ・試料押付荷重 : 30～300N



潤滑剤供給装置



試料ホルダー



研磨機本体